PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-291114

(43)Date of publication of application: 05.11.1993

(51)Int.Cl.

H01L 21/027

G03F 7/20 G03F 7/20

(21)Application number : 04-084408

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

07.04.1992

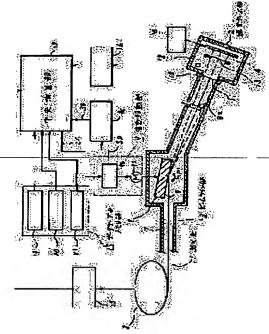
(72)Inventor: OGAWA KIYOSHI

(54) ALIGNER

(57)Abstract:

PURPOSE: To make irradiation power density constant, by correcting the change of gas concentration in an exposure chamber, the change with time of current value of an electron storage ring, the change of reflection factor due to the oblique incident angle of synchrotron radiation light (SOR light) in a swing mirror, and the fluctuation caused by the change of beam spot size.

CONSTITUTION: When an X-ray shutter 8a is opened, synchrotron radiation light (SOR light) 1 is introduced into a beam line part 3 under an ultra-high vacuum. At the same time, a control signal SA is applied to a driver 9b of a swing driving part 9 from a central operating part 18. In the central operating part



18, the swing angular velocity to the swing angle θ of a swing mirror 8 is calculated in real time, and the control signal SA is so outputted that the swing mirror 8 is driven at the calculated swing angular velocity. As the result, the swing angular velocity ω of the swing mirror 8 is sequentially changed so as to correct the 'fluctuation' of exposure amount. Thereby the irradiation power density is made constant.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

04.02.1999

[Date of sending the examiner's decision of

🧬 rejeçtion]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3090372

[Date of registration]

21.07.2000

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

21.07.2004

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(川)特許出順公開番号

特開平5-291114

(43)公開日 平成5年(1993)11月5日

(51)Int.CL ⁵ H 0 I L 21/02	級別記号 7	庁内監理番号	FI	技術表示箇所
G03F 7/20	5 0 3 5 2 1	7818—2H 7818—2H		
				:
(21)出類番号	特類平4-84409		(71)出版人	000003078
				株式会社東芝
(22)出頭日	平成 4年(1992) 4	月7日		神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
			(72)発明者	
				神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株式会社東芝磯子工場内
			(74)代理人	弁理士 則近 憲佑

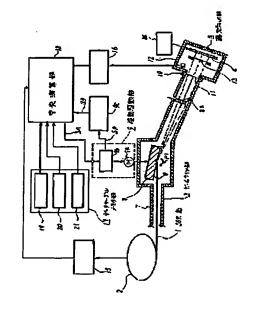
(54)【発明の名称】 露光装置

(57)【要約】

(修正有)

【構成】本発明の露光感圖は、揺動ミラー8の揺動角及 び窓光チャンパ部5内の気体濃度及び電子蓄積リング2 の電流値の路データをリアルタイムで検出するととも に、これの諸データと、あらかじめ設定されている揺動 ミラー8の揺動角速度算出式に基づき最適な揺動ミラー の指動角速度を決定し、この揺動角速度で揺動ミラー8 をリアルタイムで可変的に駆動するようにしたものであ

【効果】上記構成を有する翠光装置は、 <イ>露光チャ ンバ部内の気体波度の変化、<ロ>電子蓄積リングの電 流値の経時変化、<ハ>指動ミラーへのSOR光の斜入 射角による反射率の変化、<ニ>揺動ミラーへのSOR 光の斜入射角によるビームスポットサイズの変化。によ る電光量の変動を結構して、照射パワー密度が一定にな るように均一に窓光することができるようになる。



【特許請求の範囲】

【語求項1】下記模成を具備することを特徴とする選先 装置。

- (イ) SOR光を発生する電子蓄積リング。
- (ロ)上記電子整領リングから放射されたSOR光を超 高真空中にて垂直方向に走査する揺動ミラーを有するビ ームライン部。
- (ハ) 内部に気体が充填され且つ紋翠光体を収納してこの検翠光体に上記ビームライン部から導入されたSOR 光を照射させる翠光チャンパ部。

(ニ) 上記経動ミラーの揺動角を検出する揺動角検出手 段と、上記算光チャンパ部内の気体造度を検出する気体 濃度検出手段と、上記電子蓄積リングの電流値をリアル タイムで検出する電流値検出手段と、上記揺動角に対す る上記SOR光の上記編剪ミラーにおける反射率との関 係を示す第1パターンテーブルが格納されている第1パ ターンテーブルメモリと、上記謡動角に対する上記彼匹 光体における上記SOR光のビームスポット面積を示す 第2パターンテーブルが格納されている第2パターンテ ープルメモリと、上記気体波度に対する上記SOR光の 20 強度変化を示す第3パターンテーブルが格納されている 第3パターンテーブルメモリと、上記指動角検出手段に より検出された援動角及び上記気体遺度検出手段により 検出された気体遺度及び上記電流値検出手段により検出 された電流値及び貸1パターンテーブルメモリに協納さ れている第1パターンテーブル及び上記第2パターンテ ーブルメモリに格納されている第2パターンテーブルメ モリ及び上記第3パターンテーブルに格納されている第 3パターンテーブルに基づいて最適な揺動角速度を決定 しとの決定した尴動角速度で上記謡動ミラーをリアルタ イムで可変的に駆動する走査制御部。

【発明の詳細な説明】

[発明の目的]

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、SOR(シンクロトロン放射)光を用いた例えば半導体装置製造用の電光装置に関する。

[0002]

【従来の技術】図6は、従来のSOR光を用いた選光装置を示している。この露光鉄置においては、電子整備リングAから取り出されたSOR光Bは、超高真空に保たれたビームラインCに導かれる。このビームラインCに導かれたSOR光Bを露光に用いる場合は、露光チャンパDに設けたX線マスクEと基板Fに対して照射する。しかし、SOR光Bは垂直方向の拡がり角が狭いため、SOR光Bを垂直方向に走査する必要がある。そこで、ビームラインC中にミラーGを設け、これを認動することが行われている。

【0003】ととろで、ミラーGに対するSOR光Bの 50

斜入射角と、このミラーGにおけるSOR光Bの反射率 とは、斜入射角のがわずかに増加しただけでSOR光B の反射率が急激に減少する関係にある。また、SOR光 Bを呆光(コリメート)するためにミラーGとして例え はトロイダルミラーのような非球面ミラーを用いる場合 は、X很マスクE上におけるSOR光Bのスポットサイ ズ(面積)が、SOR光Bの斜入射角とともに変化す る。また、電子整論リングAは、その整備電流値Iが時 聞とともに変化する。すなわち、蓄積電流値は、時間の 経過とともに減少する。さらに、露光チャンパD内にお 19 ける気体(Heなど)の造度変化により、X線マスクE に達するSOR光Bの強度が変化する。このように、X 線マスクEに照射されるSOR光Bの強度は、さまざま な要因により複雑に変動し、この変動が基板下の認光精 度を低下させている。

2

[0004]

【発明が解決しようとする課題】以上のように、従来の 第光鉄圏は、SOR光のパワー密度が変動するため、基 板上の露光量が不均一となる結果、露光パターンも均一 でなくなる。

【0005】との発明は、上記草情を顧臨してなされたもので、上述した従来の電光装置がもっている技術的課題を解決し、均一に露光することが可能な露光装置を提供することを目的とする。

[発明の模成]

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の露光装置は、編 動ミラーの揺動角及び露光チャンバ部内の気体遺態及び 電子整請リングの電流値の諸データをリアルタイムで検 出するとともに、これの諸データと、あらかじめ設定されている揺動ミラーの揺動角速度算出式に基づき最適な 揺動ミラーの揺動角速度を決定し、この揺動角速度で揺 動ミラーをリアルタイムで可変的に駆動するようにした ものである。

[0007]

【作用】上記補成を有する超光装置は、<イ>超光チャンパ部内の気体機度の変化、<ロ>電子蓄領リングの電流値の経時変化、<ハ>指跡ミラーへのSOR光の斜入射角による反射率の変化、<二>援助ミラーへのSOR 代の斜入射角によるビームスポットサイズの変化、による超光量の変勁を結僕して、照射パワー密度が一定になるように均一に超光するととができるようになる。 【0008】

【実施例】以下、本発明の一実施例を図面を容照して詳 述する。

【0009】図1は、この実施例の変光装置を示している。この露光装置は、SOR光1を発生する電子整備リング2と、この電子蓄価リング2から放射されたSOR光1を超高真空中にて実内し受直方向に定査するビームライン部3と、例えばPMMAなどのレジスト機R(厚

さ例えば最大 1 µ m程度) が被者された例えばシリコン ・ウェハなどの墓板4を収納する露光チャンバ部5と、 基板4におけるSOR光1による露光量が常に一定とな るようにビームライン部3におけるSOR光1の走査を 制御する定査副副部6とからなっている。しかして、営 子整積リング2は、例えば、図示せぬが、弱集東型の単 体超電導磁石、電子ビーム入射機構、曲管空洞による高 国波加速システムおよびクライオポンプ内蔵復合多定機 造の超高真空箱からなっている。そして、この電子蓄積 リング2の主なパラメータである菩債エネルギーは例え は700MeV程度、電流は例えば100mA程度であ る。さらに、ビームライン部3は、一端部が電子整備リ ング2に連絡され内部が超高真空状態に真空引きされる バイブ7と、とのパイプ7内の中途部に揺動自在(矢印 P1方向)に配設された例えばトロイダルミラーなどの ような非球面ミラーなどからなる揺動ミラー8と、この 揺跡ミラー8を揺動駆動する揺動駆動部9と、パイプ7 の他端部に取付けられたSOR光取出窓部10と、この SOR光取出窓部10と揺動ミラー8との間に開閉自在 射させるX線シャッタ8aとからなっている。ここで緩 動ミラー8は、いわゆる斜入射ミラーであって、SOR 光1を例えば1°~3°の範囲内で入射させるように設 けられている。また、SOR光取出窓部10は、厚さ例 えば30μmのBe窓llを有している。このBe窓l 1の大きさは、揺動ミラー8により走査されたSOR光 1をすべて透過させることができる大きさに設定されて いる。さらに、指動駆動部9は、その指動軸に指動ミラ -8が取付けられたステップモータ9aと、このステッ プモータ9 a に駆動制御のためのパルス信号SPを印加 30 板4を常に均一に露光することができるように、副御す するドライバ9 b とを有している。一方、靍光チャンバ 部5は、パイプ?の他端部を内部に気密に格納するチャ ンバ12と、Be窓11に対向して設けられ且つX線マ スク13及び墓板4を例えば最大50 µmの間隔で離隔 させた状態で保持するとともにSOR光lによる窓光位 置を適宜変更させるためのステップ移動を行う位置決め テーブル機構14とからなっている。しかして、チャン バ12内は、例えば1気圧のヘリウム(He)気体が充 填されている。しかし、不純物として酸素(O2)も含 有している。したがって、チャンバ12内にては、真空 40 中と異なり、位置決めテーブル機構14の材質や構造に 制約を受けない。さらに、走査制御部6は、電子蓄積リ ング2の電流値 I を検出する蓄積電流値検出部 1.5 と、 チャンバ12内の酸素気体濃度Dを検出する気体濃度検 出部16と、、パルス信号SPを入力し揺動ミラー8の 揺動角θを示す揺動角信号Sθを出力する揺動角信号出 力手段9 c と、 各種データテーブルが格納されたデータ テーブルメモリ部17と、上記書補電流値検出部15に て検出された電流値!及び気体濃度検出部16にて検出 された酸素気体濃度D及び揺動角信号出力手段9cから

出力された揺動角&並びにバターンテーブルメモリ部1 7に格納されている各種パターンテーブルに基づいて揺 動ミラー8の最適な揺動角速度ωを算出しこの算出結果 に基づいて揺動駆動部9を訓御する中央演算部18とか - ちなっている。しかして、パターンテーブルメモリ部1 7は、図2に示すSOR光1の揺動ミラー8への斜入射 角θと反射率P(θ)との関係を示すパターンテーブル が格納された第1パターンテーブルメモリ19と、図3 に示すSOR光1の揺動ミラー8への斜入射角のと基板 4上におけるビームスポットサイズA(θ)との関係を 示すパターンテーブルが格納された第2パターンテーブ ルメモリ20と、図4に示す酸素気体濃度Dと基板4に 到達したSOR光1の強度H(D)との関係を示すパタ ーンテーブルが铬納された第3パターンテーブルメモリ 21とからなっている。ことで、反射率P(θ)は、次 式(1)で表すことができる。

 $P(\theta) = P1/P2$ (1)

【0010】ただし、P1は揺動ミラー8への入射SO R光1の強度、P2は揺動ミラー8にて反射した出射S に設けられSOR光1を適時に露光チャンバ部5側に投 20 OR光1の強度である。また、ビームスポットサイズA (θ)は、次式(2)で表すことができる。

> $A(\theta) = A1/A2$ (2)

【0011】ただし、A2はSOR光1が基準となる斜 入射角 0 で揺動ミラー8に入射したときのビームスポ ットサイズ、また、A1はSOR光1が基準となる斜入 射角&で揺動ミラー8に入射したときのビームスポット サイズである。 さちに、中央演算部18は、後述する手 順で、揺動駆動部9を基板4に到達するSOR光1の強 度が常に一定となるように、即ち、SOR光1により基 るように設定されている。つぎに、上記機成の電光装置 の作動について説明する。

【0012】まず、X線シャッタ8aを開成すると、電 子蓄積リング2にて発生したSOR光1は、超高真空中 下のビームライン部3に導入される。 これと同時に中央 演算部18からは制御信号SAが揺動駆動部9のドライ バ9 bに印加される。すると、このドライバ9 b から は、副御信号SAに従ってパルス信号SPがステップモ ータ9aに印削される。しかして、とのステップモータ 9 a は、パルス信号SPに従って所定の揺動角速度ωで 矢印P1方向に揺動する。一方、ドライバ9 りからのパ ルス信号SPは、揺動角信号出力手段9cにも出力され る。そして、とのパルス信号SPを入力した揺動角信号 出力手段9 cでは、パルス信号SPが揺動ミラー8の揺 動角 & に変換される。ついで、揺動角信号出力手段9 c からは、揺動角 8を示す揺動角信号 8 8が中央演算部 1 8に出力される。この揺動角信号S 8を入力した中央演 算部18にては、基板4上における露光量が最適となる 揺動角速度ωを次式(3)により算出する。

$\omega = K \cdot \{P(\theta) / A(\theta)\} \cdot \{1 / I_0\} \cdot H(D) \cdots (3)$

【0.013】ただし、 $P(\theta)$ は、前途したように、緩 動ミラー8におけるSOR光1の反射率であって、式 (1) で表される。この $P(\theta)$ は、指動角信号出力手 段9 cから出力された揺動角θに基づき第1パターンテ ープルメモリ19に格納されているパターンテーブルに より算出される。また、A(θ)は、前述したように、 SOR光1の基板4上におけるビームスポットサイズA であって、揺動角信号出力手段9 c から出力された揺動 角分に基づき第2パターンテーブルメモリ20に格納さ 10 れているパターンテーブルにより算出される。さらに、 H(D)は、芸板4に到達したSOR光1の強度H

(D) であって、第3パターンテーブルメモリ21に格米

【① O 1 4】ただし、Ed は、露光面のエネルギ密度で ある。すなわち、式(3)は、露光面のエネルギ密度E を一定としたときに揺動角速度のについて解いたときの 式である。なお、揺動ミラー8の揺跡 $室 \Delta \theta$ は、あらか じめ θ 1 と θ 2 との間に設定されている。かくして、中 央湾笋部 $1\,8$ にては、heta1 かちheta2 まで、緩動ミラー8 $\,$ 30 の電流値の踏データをリアルタイムで鈴出するととも の揺動角 θ に対する揺動角速度 ω をリアルタイムにて算 出し、この算出した揺動角速度ので揺動ミラー8が揺動 するように制御信号SAを出力する。

【0015】その結果、指動ミラー8は、一定の揺動角 速度でなく、<イ>酸素気体濃度Dの変化、<ロ>電子 蓄積リング2の電流値!の経時変化。<ハ>揺動ミラー 8へのSOR光1の斜入射角 θ による反射率 $P(\theta)$ の 変化. <ニ>揺動ミラー8へのSOR光1の斜入射角& によるビームスポットサイズの変化。による露光量の "ゆらぎ"を補償するように、選次にその揺動角速度w が変化する。これにより、テーブル機構14により逐次 位置決めされている基板4上のレジスト順Rは、X線マ スク13を介して、照射パワー密度が一定になるように

均一に盆光される。

【0.016】なお、上記実施例においては、揺動角 θ を 示す信号SBをバルス信号SPに基づいて揺動角信号出 力手段9 c にて得ているが、中央演算部18からのは制 御信号SAそのものを利用して、揺動ミラー8の揺動角 θを検出し、露光量が最適となる揺動角速度ωをリアル タイムで算出するようにしてもよい。さらに、上記実施 40 例においては、Be窓11は固定する方式について例示 しているが、Be窓11を追動ミラー8の揺動に同期し て上下方向 (SOR光1の走査方向) に揺動するように してもよい。との場合、Be窓llの厚さを薄くするこ とができるので、Be窓llによるSOR光1の吸収を 少なくすることができるようになり、スループットが向 上する利点を有している。ただし、この場合は、最適と

*納されているパターンテーブルにより算出される。 さら に、【は、経過時間ものときの電子蓄積リング2の電流 値、また、 Io は基準電流値である (図5 参照)。 な お、電子蓄積リング2の電流値は、時間の経過とともに 減少する傾向を有している。さらに、Kは、萬光面密度 を決定する比例定数である。この式(3)は、墓板4上 における露光量を常に一定とするためには、揺動角速度 ωとA(θ)は、反比例関係にあることを示している。 また、P(θ)、1/10及びH(D)は、比例関係に あることを示している。このような(3)は、次式 (4) により導入されたものである。

 $Ed = K \cdot \{P(\theta) / A(\theta)\} \cdot (I/I_0) \cdot H(0) \cdot (I/\omega) \cdots (4)$

なる指動角速度ωに同期してBe窓11の揺動を副御す るようにしなければならない。

[0017]

【発明の効果】本発明の露光装置は、揺動ミラーの揺動 角及び露光チャンパ部内の気体濃度及び電子蓄積リング に、これの諸データと、あらかじめ設定されている揺動 ミラーの揺動角速度算出式に基づき最適な揺動ミラーの 揺動角速度を決定し、この揺動角速度で揺動ミラーをリ アルタイムで可変的に駆動するようにしたので、<イ> 露光チャンパ部内の気体機度の変化。 <ロ>電子蓄積リ ングの電流値の経時変化。 <ハ>揺動ミラーへのSOR 光の斜入射角による反射率の変化、<ニ>揺動ミラーへ のSOR光の斜入射角によるビームスポットサイズの変 化、による露光量の変動を補償して、照射パワー密度が 一定になるように均一に露光することができるようにな

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の無光装置の全体を示す斜視 図である。

【図2】SOR光の揺動ミラーへの斜入射角と反射率と の関係を示すグラフである。

【図3】SOR光の揺動ミラーへの斜入射角と墓板上に おけるビームスポットサイズとの関係を示す

【図4】酸素気体濃度と華板に到達したSOR光の強度 との関係を示すグラフである。

【図5】電子整債リングの電流値の経時的変化を示すグ ラフである。

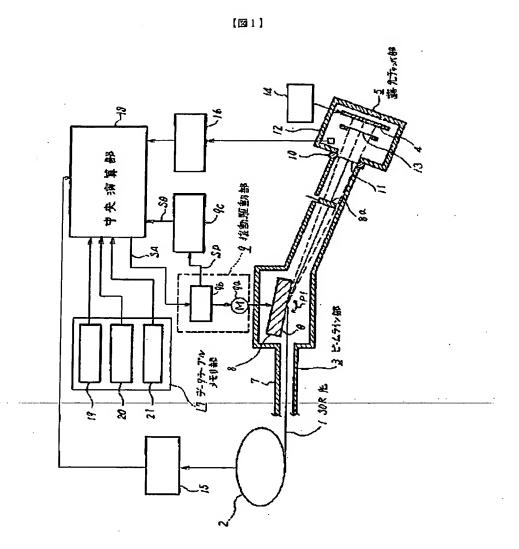
【図6】従来技術の説明図である。

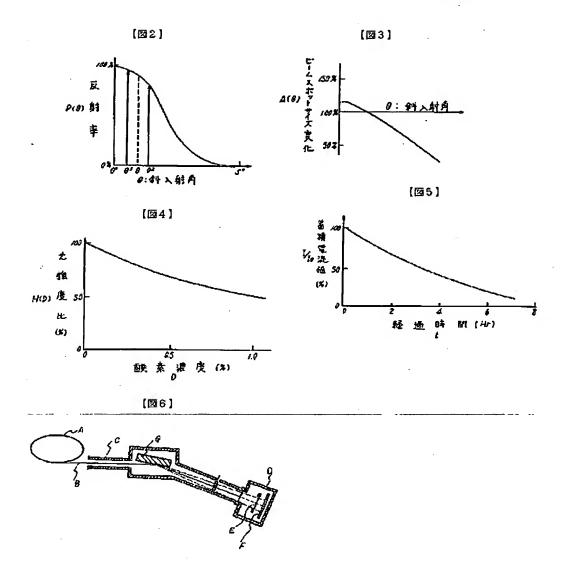
【符号の説明】

1: SOR光、2: 電子蓄積リング、3: ビームライン 部、4:基板、5:露光チャンパ部、6:走査制御部、 8: 揺動ミラー。

(5)

待関平5-291114





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.